

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成20年12月4日(2008.12.4)

【公表番号】特表2008-519904(P2008-519904A)

【公表日】平成20年6月12日(2008.6.12)

【年通号数】公開・登録公報2008-023

【出願番号】特願2007-540188(P2007-540188)

【国際特許分類】

C 23 C 14/24 (2006.01)

H 05 B 33/10 (2006.01)

H 01 L 51/50 (2006.01)

【F I】

C 23 C 14/24 A

H 05 B 33/10

H 05 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成20年10月15日(2008.10.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

気化した有機材料の基板表面への堆積を制御する方法であって、

a) 基板表面に堆積させるために気化した有機材料を通過させる少なくとも1つの開口部を有するマニホールドを用意し；

b) ある体積の有機材料を供給し、第1の状態では、その有機材料の蒸気圧が、基板に層を有效地に形成するのに必要であるよりも低い値になるようにその有機材料の温度を維持し、第2の状態では、加熱されたその有機材料の蒸気圧が、層を形成するのに十分な大きさになるようにその有機材料の初期体積の一部を加熱する操作を含む方法。

【請求項2】

温度制御領域に透過性加熱素子を設置して有機材料の初期体積の一部を加熱し、その加熱した透過性加熱素子を用いてその透過性加熱素子に隣接する有機材料を気化させ、気化した有機材料をその透過性加熱素子を通過させて上記マニホールドの中に入れた後、そのマニホールドの開口部を通じて外に出す操作をさらに含む、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

蒸発源の中にある有機材料の気化を制御して基板表面に堆積させるための装置であって、

a) 第1の温度制御領域において、有機材料を、その有機材料の気化温度よりも低い温度になるまで加熱するための第1の加熱手段と；

b) 第2の温度制御領域においてその有機材料を気化温度よりも高温に加熱するための第2の加熱手段と；

c) 有機材料を計量して第1の温度制御領域から第2の温度制御領域に供給することにより、その有機材料を気化させて基板表面に形成する手段と；

d) 第2の温度制御領域に与える温度を制御する手段を備える装置。